

公開番号 又は 特許番号	特開 2013-247234
発明名称	大気圧プラズマ処理装置および薄膜形成方法
出願人 又は 権利者	三菱電機株式会社
想定デバイス	シート型健康管理デバイス、アンビエントデバイス、エネルギーハーベスティング
要約	<p>【利用分野】 表面処理と成膜処理との間に被処理面が汚染されることなく連続処理を実施することが可能な大気圧プラズマ処理装置を得ること。</p> <p>【発明の内容】 ステージ51と、ステージ51に対向して配置される入力側高周波電極11と、反応ガス流路、カーテンガス流路および排気流路を有する流路構成部材12と、を含むプラズマ処理ヘッド10と、ステージ51と入力側高周波電極11との間に高周波電力を印加する高周波電源16と、入力側高周波電極11のステージ51と対向する面に配置される非反応性ターゲット14および反応性ターゲット13と、基板100が非反応性ターゲット14から反応性ターゲット13へと移動するようにステージ51と入力側高周波電極11を相対的に移動させる移動手段53と、を備える。</p>
図面	